白光中子源MTPC阻性Micromegas探 测器的气隙均匀性研究

报告人: 吕游 中国科学院高能物理研究所 散裂中子源科学中心

2022年高能所博士后学术论坛



- ≻ 白光MTPC研究背景
- ➢ 阻性Micromeags探测器气隙均匀性研究
 - ・模拟研究
 - ・实验刻度



研究背景

◆ CSNS反角白光中子源主要研究方向之一

- 两体反应
 - ⁶Li、¹⁰B的(n,α)反应
 - ¹²C、¹⁶O的(n,p)、(n,d)、(n,t)、(n,α)反应
- 三体反应:
 - ¹²C的(n,3α)反应
- ◆ 现有实验装置:轻带电粒子探测器阵列(LPDA)
- 8个ΔΕ-ΔΕ-Ε探测单元,每个单元由MWPC、Si和Csl
 组成
- 覆盖立体角小 (0.2%)
- 粒子探测能量阈值高,约为0.5MeV (Proton)
- 主要针对(n,p/d/t)(n,α)等轻带电粒子反应的测量
- ◆ LPDA的限制:小截面、低能产物和多产物反应的测量有较大难度



轻带电粒子探测器阵列示意图



白光MTPC探测器方案

70mm~150mm

Cathode

- ◆ 研制一台主要针对轻带电粒子测量的多用途TPC (Multi-purpose TPC)
- 径迹测量、能量测量、粒子鉴别
- 大立体角覆盖、能量探测阈值低
- 粒子甄别与复杂反应道甄别



◆ MTPC核心部件之一: 阻性Micromegas探测器作为放大结构

阻性Micromeags探测器

- ◆阻性Micromegas探测器
- 工艺成熟、国产化、大面积
- 高增益、高精度
- ◆ 阻性阳极
- 猝灭探测器的打火放电,提升工作稳定性
- 扩展阳极信号的宽度,提升位置重建精度



阻性Micromegas放大区结构示意图



热压接技术制备Micromegas探测器

- ◆ 影响MTPC性能的关键参数
- 位置重建精度:读出单元尺寸、阻性电极阻值
- ・ 能量重建精度: 探测器增益均匀性、雪崩放大气隙



≻ 白光MTPC研究背景

➢ 阻性Micromeags探测器气隙均匀性研究

- ・模拟研究
- ・实验刻度



实验设置

◆ Micromegas探测器参数: 阻性层面电阻率约100MΩ/sq, 六边形密堆Pad读出 方式,读出Pad边长1.63mm,共1519个阳极pad,灵敏区边长约68.5mm,使 用Fe⁵⁵放射源测试。





▶ 读出电子学:基于分立元件实现电荷灵敏前放,波形采样技术



阻性层电荷扩散

- ◆ 读出pad上的信号成分:
- 电子雪崩放大过程中产生的感应 信号
- 电子在阻性层上扩散产生的感应 信号
- 不同区域的pad具有不同的响应 函数(PRF)



- ◆ 电子在阻性层上的扩散过程参数化为二维RC网络的电荷扩散问题
- ◆ 模拟计算得到读出Pad的PRF, 结合实验刻度出探测器雪崩区的气隙厚度





不同时刻阻性层上的电荷分布







原始信号波形

$$H_1(t) = \frac{1}{C_0} \left(-\frac{e^{-\frac{t}{\tau_0}}}{\tau_0} + \frac{e^{-\frac{t}{\tau_r}}}{\tau_r} \right)$$
$$H_2(t) = \delta(t) + \frac{1}{\tau_0} \left(1 - \frac{\tau_0}{\tau_1} \right) e^{-\frac{t}{\tau_1}}$$
$$H_3(t) = \frac{1}{\tau_1} e^{-\frac{1}{\tau_1}}$$

响应函数







模拟结果与实验测试结果吻合较好

探测器能量修正

◆ 计算得到读出pad的响应函数,对实验测试得到的探测器能量进行修正



◆ 探测器能量修正

 $SumE_1 = 1.18125 * SumE_0/y(x)$

amplitude to the position calculated by charge of centroid (通过实验进行测量)

DMCG: distance from the center of pad with maximum

 $y(x) = 1.18125 + 0.0788079x - 0.758979x^2 + 0.757026x^3 - 0.223732x^4$

气隙刻度方法



Garfield++模拟得到气体汤生系数

测试探测器不同区域、不同电压下的能谱,

探测器气隙刻度

1.

2.



模拟得到的气体汤生系数



气隙刻度结果



探测器灵敏区内气隙厚度分布

探测器灵敏区内气隙厚度分布

- ◆ Micromegas探测器雪崩区气隙
- 1. 灵敏区分成127个小区域,平均气隙厚度为95 μm
- 2. 气隙厚度非均匀性约2.8% (RMS/Mean)

探测器边缘具有较大的气隙厚度,可能是由于热压过程当中,边缘区域受力较小,导致气隙厚度较大。

增益均匀性 vs. 气隙均匀性



◆ 相同工作电压, 可以通过探测器

$$\frac{\sigma_G}{G} = B\sigma_d + \frac{B^2}{2!}\sigma_d^2$$

◆ 模拟得到的B和实验测测量的B 在误差范围内是一致的,进一步 验证了该结果的自洽性



不同工作电压下的增益偏差以及气隙厚度偏差依赖关系

| Voltage(V) | -560 | -570 | - <mark>5</mark> 80 | -600 |
|---|--------|--------|---------------------|--------|
| $B_i(\mathrm{cm}^{-1})$ | -542.7 | -533.5 | -553.8 | -542.1 |
| $\sigma_i(\mathrm{cm}^{-1})$ | 11.3 | 4.9 | 4.6 | 3.5 |
| $\left B_{i}-B\right /\sqrt{\sigma^{2}+\sigma_{i}^{2}}$ | 0.02 | 1.43 | 1.71 | 0.14 |

总结

- 1. 通过模拟和实验研究了Micromegas探测器中电子在阻性层上的扩散效应, 计 算得到探测器读出Pad的响应函数, 进一步得到探测器的能量修正函数。
- 结合模拟和实验,刻度了Micromegas探测器雪崩区气隙厚度,结果显示探测器雪崩区气隙厚度平均值为95 μm,气隙厚度非均匀性约为2.8%。通过探测器的增益涨落和气隙涨落的依赖关系,进一步验证了结果的自洽性。
- 3. 通过对探测器灵敏区内雪崩区气隙的刻度,可以给阻性Micromegas探测器 的工艺优化提供依据,并且可以给出任意工作条件下探测器灵敏区内的能量 修正函数,从而优化MTPC探测器的性能。
- 4. 该研究结果已撰写成文投到NIMA期刊上,并已经被接收。

